



一种用于单胞超导腔内表面化学抛光的磁搅拌装置

文献类型: 专利

作者 马震宇; 刘建飞; 侯洪涛; 封自强; 毛冬青; 罗琛

发表日期 2014-05-08

专利国别 中华人民共和国

专利号 CN203944331

专利类型 实用新型

权利人 中国科学院上海应用物理研究所

中文摘要 本实用新型提供一种用于单胞超导腔内表面化学抛光的磁搅拌装置, 包括: 围绕超导腔赤道外侧设置的可旋转的环形圆盘, 所述圆盘周向均匀分布有永磁铁, 所述圆盘外侧套有同步带; 通过所述永磁铁吸附于超导腔赤道内表面的磁性搅拌子; 以及带有与所述同步带相配合的同步齿轮的发动机。本实用新型的用于单胞超导腔内表面化学抛光的磁搅拌装置, 通过发动机带动围绕超导腔赤道外侧设置的环形圆盘旋转, 于是周向均匀分布在圆盘中的永磁铁带动吸附于超导腔赤道内表面的磁性搅拌子随之旋转, 可以简单直接地提高超导腔赤道处内表面的酸液流动速率, 有效驱逐附着在内表面上的化学残渣和气泡, 改善化学抛光效果, 并且可以通过调节发动机转速控制化学反应速率。

分类号 B01F13/08

语种 中文

专利申请号 CN201420233937

源URL [<http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/25418>]

专题 上海应用物理研究所_中科院上海应用物理研究所2011-2017年

作者单位 中国科学院上海应用物理研究所

推荐引用方式 马震宇,刘建飞,侯洪涛,等. 一种用于单胞超导腔内表面化学抛光的磁搅拌装置. CN203944331. 2014-05-08.

GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [上海应用物理研究所](#)

浏览	下载	收藏
166	36	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。